



## WaferSense™ オートレベルシステム 2 (ALS2)



上: WaferSense ALS2300C  
右上 Inset top: ALS2200C  
右下 Inset bottom: ALS2200CF

自動搬送出来る  
薄型構造です

**WaferSense™ ALS2**は半導体プロセス装置向けに開発されたウエハ傾斜レベル調整用ツールです。ウエハライクでワイヤレス（リアルタイム観測）なので、あらゆる位置に自動搬送させて調整やトラブルシューティングを簡単に行うことができます。薄型で頑丈なカーボンファイバー製なので安心して末永く使用することが可能になりました。

今まで出来なかった高精度で再現性のある調整を行うことにより装置をよりよい状態に保つことができます。

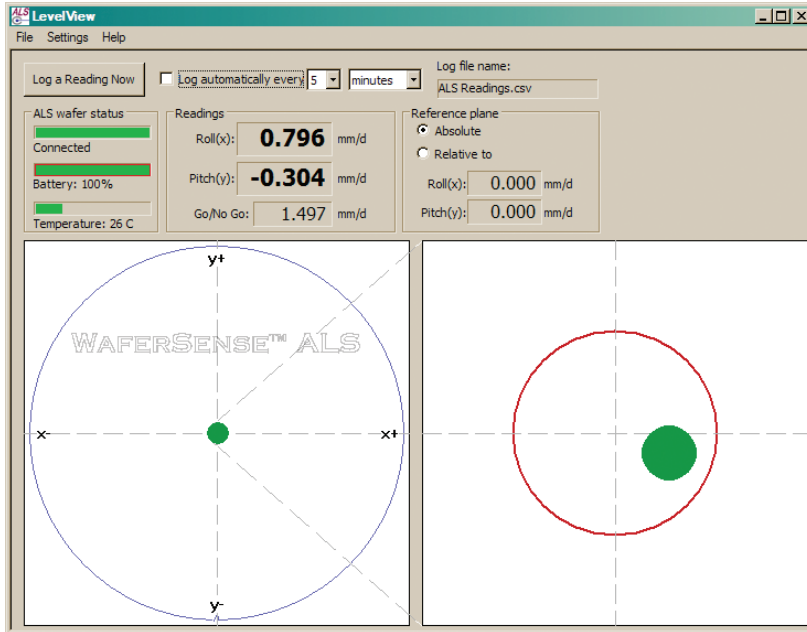
**ウエハライクだから:最適な装置調整を提供。**ALS2 ウエハを使ってカセットFOUP、エンドイフェクター、アライナー、ロードロック、リフトピン、そしてチャンバー内のペDESTルまで、たとえ真空中であっても、搬送させながらの測定が可能です。薄型なので、より多くのプロセスステーションにアクセス出来るようになりました。ALS2があれば、実際にウエハが感じている傾斜レベルを誰でも簡単に再現性良く測定し、少ないバラツキで装置調整出来ます。

**デジタル数値だから:装置調整の標準化を実現。**客観的なデジタル数値があれば、今まで経験と勘に頼っていた所の人為的なバラツキを減らす事が出来ます。付属のLevelviewアプリケーションはグラフィック表示された傾斜レベルとデジタル測定値の両方を提供し、リアルタイムフィードバックを実現します。ALS2があれば、標準化された目標値以内に誰でも簡単に調整出来るので、各プロセスの均一性を高める事が可能です。

**ワイヤレスだから:メンテナンス時間を大幅に短縮。**狭くて危険な所へ搬送させての測定とフィードバック調整が出来る利便性と安全性から、装置調整の時間が大幅に短縮されます。ALS2があれば、短時間で調整作業を終わるので、作業時間と装置停止時間が減り、稼働率向上に役立ちます。

**いろんな応用を実現出来るから:生産性が向上します。**メッキやインプラント工程では、ウエハ傾斜精度が歩留まりに直接影響します。またリフトピンとペDESTル上のウエハを並行に調整すればコンタミ発生を低減し、カセットやFOUP、ボート内のウエハがエンドイフェクターと並行であれば、ウエハへの傷が減少します。ALS2があれば、工場全体の不良要因を減らし、より高い生産性を求めることが出来ます。

## WaferSense ALS2 パッケージ

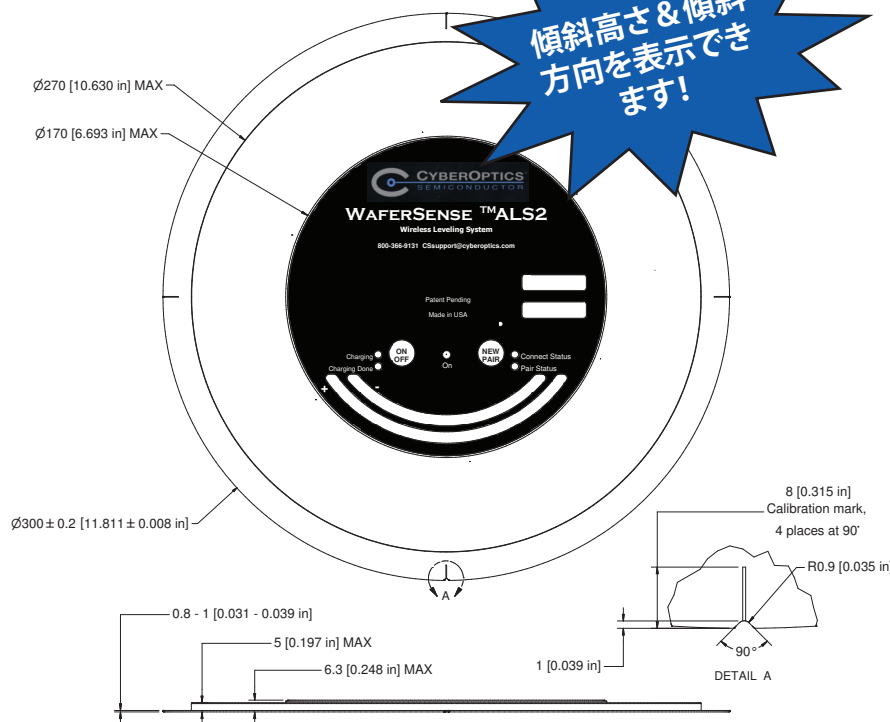


上: アプリケーションが簡単に操作出来るグラフィカルな「泡」表示とデジタル表示を提供します。

右: ワイヤレスリンク (Bluetooth採用) はコンパクト形状 (92mmx58mmx28mm) でありUSBポート使ってパソコンと接続されます。



## 寸法 (ALS2300C)



上は ALS2300C の寸法図面です。ALS2200C と ALS2200CF の寸法図面についてはカスタマーサポート CSsupport@cyberoptics.com までお問い合わせ下さい。

## 特徴

**ワイヤレスでウエハライク形状:** ウエハと同じように搬送出来ます。

**外形:** SEMI 標準の形状 (200mmはVノッチまたはオリフラ。300mmはVノッチ)

**薄型&軽量:** 中央部 (直径170mm) 厚み 6.3mm、150g (200mm) 、240g (300mm)

**ハウジング材質:** カーボンファイバー系。コーティングは耐摩耗性と耐温性を持ちます。

**2種類の寸法を表示:** XとYの方向の傾斜を同時表示。傾斜高さと傾斜方向の表示に切り替えることも出来ます。

**精度:**  $\pm 0.03$  度 (傾斜が $\pm 7$ 度以下)

**測定範囲:**  $\pm 14$  度 (絶対水平面より)

**分解能:**  $\pm 0.002$  度

**真空互換性:** 非常に少ないコンタミ発生の材質を採用しています。 $10^6$  トールまでの使用が可能。

**使用温度:** 20度 - 70度。

**バッテリー寿命:** 充電後 4時間

**Bluetooth通信:** 2.4 GHz帯

**USB 1.1 ワイヤレスリンク:** 外寸 92 mm x 58 mm x 28 mm。

**LevelView™ グラフィカルユーザーインターフェイス:** 傾斜を泡表示させ、かつデジタルでも表示します。簡単に操作可能。

**データLOG:** 全ての測定データは自動またはマニュアルにてLOG保存可能。エクセルにて簡単に読み出しが可能で、編集も可能です。

**相対測定:** 参照面を登録し、そこからの傾斜を測定出来ます。平行度や変位を簡単に測定出来ます。

**オペレーティングシステム:** Windows® 2000, XP, Vista.

**パッケージ梱包物:** レベリングウエハ、ワイヤレスリンク、アプリケーションソフト、充電クリーンBOX及びキャリアケース

**校正:** 毎12ヶ月の校正を推奨



1355 SW Millikan Way  
Beaverton, Oregon 97005

Phone: 800.366.9131 or 503.495.2200  
Fax: 503.495.2201  
Email: CSsales@cyberoptics.com  
Web: www.CyberOpticsSemi.com